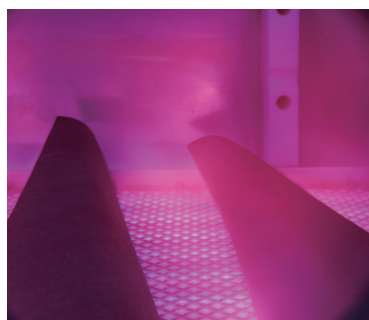


### Vacu TEC 5050 标准型真空等离子设备

#### 产品特征:

- 安装简便
- 使用简单
- 处理速度快
- 真空
- 可接入辅助气体
- 过程控制
- 低成本处理方式



Tantec VacuTEC 5050真空等离子处理是适合大一些的不同材质的注塑产品的处理。该设备快速的处理速度为下游工艺的涂层、胶水、印刷、喷涂提供了最佳的产品表面能与很好的结合性。

该设备的真空腔体与智能集成等离子电极组合实现了在0.1-- 3Mbar状态下等离子体的精准放电,同时处理时间也很短,一般状态下针对不同的材料有不同的组合方案,处理时间一般控制在5 - 600秒左右。

VacuTEC5050真空等离子处理设备具有操作简单、生产加工速度快等优点。处理过程中可以加入像氩和氧气等辅助气体来提升表面处理效果,但在大多数情况下,因为高功率的等离子体放电一般不需要气体来辅助参与。

VacuTEC5050采用先进的Tantec主机HV-X系列作为电源,特别设计的高频高压变压器为等离子体电极提供了强大的功率输出。

Tantec不仅有标准的真空技术设备,也有定制设计的设备。真空技术定制机器是专门以客户标准开发的来100%适应客户的生产线。

#### Head Office

Tantec A/S  
Industrivej 6  
DK-6640 Lunderskov  
(+45) 7558 5822

Mail:  
sales@tantec.com

Web:  
www.tantec.com  
www.china-tantec.com (中文)

中国区总代:  
昆山市坦钛等离子科技有限公司

Tel:  
0512-50333890

Mobile:  
13862667395

Mail:  
sales@china-tantec.com

## 特点:

- 安装简便 仅需连接电源和压缩空气。
- 处理速度快 高效的输出功率可以实现不同的材料在5 - 600秒之内即可完成快速处理。
- 维护简单 本设备安装方便，操作简单，便于维护。
- 腔体门设计 采用铰链连接加视窗设计方案。
- 适用范围 可以适用于导体和非导体的任何材料表面。
- 低成本处理工艺 几乎不需要任何辅助气体即可提升材料表面的湿润性和粘性。
- 处理过程监控 整个处理过程HV-X主机与PLC实时监控，所有的参数都显示在触摸屏上。
- 真空 针对于不同的材料根据需求不同，等离子激活可以在0.1-3Mbr之间任意设定。
- 辅助气体 处理过程中可以加入像氩气、氧气、氮气的辅助气体，但一般情况下不需要。

VacuTEC 5050	
总电源/频率	100-480 VAC 50/60 Hz
输出功率	5kV / 1000W
主机类型	HV-X 等离子主机系列
压缩空气压力	6 bar 的洁净气体
辅助气体	标准气体，如需要可以添加氧气、氩气和氮气等气体
真空泵体速度	100 立方/分钟
真空度	0,1 - 3 mbar
真空释放时间	90 sec.
等离子处理时间	5 - 600 秒之间, 以实际腔体尺寸为准
控制连接方式	触摸屏控制
遵循法规	CE - RoHS - WEEE
外形尺寸	1115 x 955 x 1745 mm
设备层数:	2
托盘尺寸	500 x 500 x 100 mm